Family list 3 family members for: JP2002299595 Derived from 2 applications.

- 1 SOLID STATE IMAGING UNIT AND ITS MANUFACTURING METHOD Publication info: JP2002299595 A 2002-10-11
- Solid image pickup apparatus and production method thereof Publication Info: US6800943 B2 2004-10-05 U\$2002142510 A1 - 2002-10-03

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

SOLID STATE IMAGING UNIT AND ITS MANUFACTURING METHOD

Patent number:

JP2002299595

Publication date:

2002-10-11

Inventor:

ADACHI YOSHIO

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

H01L27/14; H01L21/60; H01L23/02; H01L25/065;

H01L25/07; H01L25/18; H01L31/02; H04N5/335

- european:

H01L27/146A4

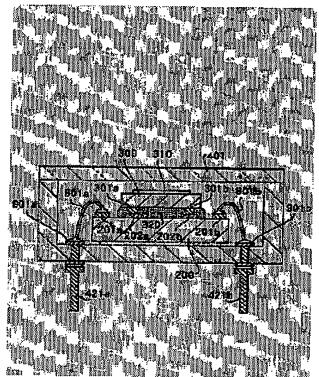
Application number: JP20010104572 20010403 Priority number(s): JP20010104572 20010403 Also published as:

US6800943 (B2) US2002142510 (A1)

Report a data error here

Abstract of JP2002299595

PROBLEM TO BE SOLVED: To ultimately reduce the mounting size of a solid state imaging unit and to remarkably decrease the mounting cost. SOLUTION: A solid state imaging element bare chip 300 is directly mounted on an LSI bare chip in which a drive circuit and a transfer circuit are integrated to form a chip-on-chip structure. An electrical conduction between the bare chips is assured by connecting bump electrodes 301a, 301b of the rear surface of the solid state imaging element bare chip to electrodes 201a, 201b of the main surface of the LSI bare chip. A resin layer (stress absorption layer) 320 made of a thick film polyimide resin or the like is interposed between the bare chips, and hence the active surface of the LSI bare chip 200 is protected.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本四特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特第2002-299595 (P2002-299595A)

(43)公開日 平成14年10月11月(2002.10.11)

(51) Int.Cl.7		數別即身		FI			ŕ	·-71-ド(参考)
HOIL	27/14			H01	L 21/60		311S	4M118
	21/60	311			23/02		F	5 C O 2 4
	73/02			HOA	N 5/335		v	5F044
	25/085			H01	L 27/14		D	5 F O 8 B
	25/07				25/08		В	
			农销查客	未請求	簡求項の数 9	OL	(全 9 頁)	最終頁に続く
(21) 出數部)	特配2001 —104572(P20	01 — 104572)	(71) #	R版(Y 00000	5821	·	

		1	40
			松下電器産業株式会社
(22) 出版日	平成13年4月3日(2001.4.3)		大阪府門真市大字門真1006番地
		(72) 発明者	安建
	·		神奈川県横浜市港北区綱島東四丁目3番1
			号 松下强信工業株式会社内
		(74)代與人	100106050

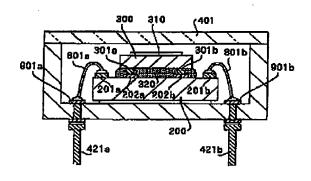
弁理士 鷲田 公一

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 因体操像整備およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 固体操像装置の実装サイズを究極的に小 型化すると共に、実装コストの大幅な削減を図ること。 【解決手段】 固体撮像素子ペアチップ300を、駆動 回路や転送回路が集積されたLSIベアチップ上に直 接、搭載して、チップ・オン・チップ構造を形成する。 各ペアチップ間の電気的導通は、固体振像素子ペアチッ プ裏面のパンプ電板301a, 301bと、LSIベア チップの主面の電極201a.201bを接続すること により確保される。各ベアチップ間には、厚膜のポリイ ミド樹脂等からなる樹脂層(応力吸収層)320を介在 させ、LSIベアチップ200のアクティブ面を保護す 8.



:(2) 002-299595 (P2002-299595A)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 固体損像素子の駆動回路が集積されたし SIベアチップ上に前記箇体機像索子のベアチップを搭 載すると共に、各ベアチップの電極同士を配線基板を介 することなく電気的に接続してなる固体操像装置。

612-455-3801

【請求項2】 固体攝像素子の駆動回路が集積されたし SIベアチップのアクティブ面上に、樹脂からなる応力 吸収層を介して前記固体振像素子のベアチップを搭載す ると共に、各ペアチップの電板同士を配線基板を介する ことなく電気的に接続してなる固体機能装置。

【請求項3】 裏面に電極が形成された固体撮像案子の ベアチップを、この固体提像素子のベアチップよりも占 有面積が大きく、かつアクティブ面上に前記固体提像器 子のベアチップとの電気的接続をとるための電極が形成 されている、固体操像素子の駆動回路が集積されたLS 「ベアチップ上に搭載し、前記固体摄像索子のベアチッ プの裏面電極と、前記しSIベアチップにおける前記固 体振像素子のベアチップとの電気的接続をとるための電 極とを直接に接続してなる固体提像装置。

【請求項4】 受光面の周囲に電極が形成された固体提 像素子のベアチップを、この固体振像素子のベアチップ よりも占有面積が大きく、かつアクティブ面上に前記周 体操像素子のベアチップとの電気的接続をとるための電 極が形成されている、固体振像素子の駆動回路が集積さ れたLSIベアチップ上に搭載し、前記園体提像素子の ベアチップの電極と、前配しSIベアチップにおける前 記固体撮像素子のベアチップとの電気的接続をとるため の電極とをボンディングワイヤにより接続してなる固体 振像装置。

【請求項5】 裏面に電極が形成された固体摄像索子の ベアチップを用意すると共に、固体撮像素子のベアチッ プより占有面積が大きく、かつアクティブ領域の周辺 に、前記固体提像素子のベアチップとの電気的接続をと るための電極が形成された、固体機像素子の駆動回路を 含むLSIベアチップを用意する工程と、

前記LSIベアチップの前記アクティブ領域の少なくと も一部とオーバーラップするように、かつ、前記固体撮 像素子のベアチップの前記裏面電極と前記しSIベアチ ップの前記第1の電極とが接触するように、固体撮像素 子のベアチップをLSIベアチップに直接に裁置し、固 定する工程と、

を含むことを特徴とする固体機像装置の製造方法。

【請求項6】 裏面に電極が形成された固体撮像索子の ベアチップを用意すると共に、固体振像紫子のベアチッ ブより占有面積が大きく、かつアクティブ領域の周辺 に、前記園体操像素子のベアチップとの電気的接続をと るための第1の電極と、外部との電気的な接続をとるた めの第2の電極とが形成された、固体振像素子の駆動回 路を含むしSIベアチップを用意する工程と、

前記しSIベアチップの前記アクティブ領域の少なくと

も一部とオーバーラップするように、かつ、前記固体提 像素子のベアチップの前記裏面電極と前記LSIベアチ ップの前記第1の電極とが接触するように、固体機像索 子のベアチップをLSIベアチップに直接に載置し、固 定する工程と.

前記LSIベアチップを、外部接続用電極が設けられて いる支持部材上に搭載して固定する工程と、

ワイヤーボンディングを行い、前記LSIベアチップの 前記第2の電極と前記支持部村の前記外部接続用電極と をポンディングワイヤで接続する工程と、

を含むことを特徴とする固体操像装置の製造方法。

【請求項7】 受光面の周辺に電極が設けられた、固体 摄像衆子のベアチップを用意すると共に、前記固体操像 素子のベアチップより占有面積が大きく、かつ、表面ま たは裏面に、前記固体振像素子のベアチップとの電気的 接続をとるための電極が形成された、固体撮像業子の駆 動回路を含むLSIベアチップを用意する工程と、

前記LSIベアチップの、前記固体撮像素子の駆動回路 が形成されている領域の少なくとも一部とオーバーラッ プするように、前記固体機像素子のベアチップを前記し SIベアチップに直接に載置し、固定する工程と、

ワイヤーボンディングを行い、前記固体摄像索子のベア チップの前記電極と、前記LSIベアチップの表面また は裏面に設けられた前記電極とをボンディングワイヤで 接続する工程と、

を含むことを特徴とする固体提像装置の製造方法。

【請求項8】 裏面に電極が形成された固体提像素子の ベアチップを用意すると共に、固体操像素子のベアチッ プより占有面積が大きく、かつアクティブ領域の周辺 に、前記固体提像素子のベアチップとの電気的接続をと るための第1の電極と、外部との電気的な接続をとるた めの第2の電極とが形成された、固体提像素子の駆動回 路を含むLSIペアチップと、を用意する工程と、

前記しSIベアチップのアクティブ領域の少なくとも一 部とオーバーラップするように、かつ、前記園体操像素 子の前記裏面の電極と前記LSIベアチップの前記第1 の電極とが接触するように、前記固体機像素子のベアチ ップを前記しSJベアチップに直接に載置し、固定する 工程と、

光透過部財が片側に配置され、反対側に導電部材および この導電部材に連接する導電領域が設けられているキャ リアテープにおける、前記導電部材を前記LSIベアチ ップの前記第2の電極と接続する工程と、

前記キャリアテープを途中で折り曲げ、折り曲げられた 部分を筐体内に挿入し、挿入されたキャリアテープを前 記筺体の内壁に密着させる工程と、

を含むことを特徴とする固体機像装置の製造方法。

【請求項9】 固体撮像素子の駆動回路が集積されたし SIベアチップのアクティブ面上に固体機像素子のベア チップを搭載し、各ペアチップの電極同士を配線基板を !(3) 002-299595 (P2002-299595A)

介することなく電気的に接続すると共に、前記固体摄像 素子のベアチップおよび前記しSIベアチップ上にコー ティングを施してパッケージ構造を形成したことを特徴 とする固体最低装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、固体提像装置およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来は、図10に示すように、固体機像 案子のパッケージ2100と、固体撮像素子の駆動回路 (信号転送系の回路も含む)のパッケージ2200を、 プリント配線基板2000を介して接続している。 【0003】

【発明が解決しようとする課題】従来の実装方法では、 パッケーシ品同士の実装であるため、実装サイズのさら なる小型化が困難である。また、配線基板が必要である ため、実装コストの削減が困難であるという問題があっ た。

【0004】本発明は、固体機像装置のような光電変換 装置の実装サイズを究極的に小型化し、また実装コスト の大幅な低減を図ることができる、固体機像装置および その製造方法を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、駆動回路のベアチップ上に固体撮像素子のベアチップを搭載して、ベアチップの階層構造を形成し、ダイレクトに(つまり、プリント配線基板等の基板構造を介することなく)、各ベアチップ間の電気的接続をとるものである。

【0006】ベアチップを積層する構造であるため、実質的な実装サイズ(占有面積)は、下側(支持側)のベアチップのサイズとなり、固体撮像索子の実装サイズの究極的な小型化を図ることができる。

【0007】また、プリント配線基板等の余分な部材がいっさい介在しないため、固体撮像装置の実装のローコスト化を実現できる。

[0008]

【発明の実施の形態】(実施の形態1)図1は、本発明の固体温像装置の一例を示す断面図である。

【0009】図1において、固体機像素子が集積された 固体操像素子ベアチップ300は、固体操像素子の駆動 回路(信号転送回路やその他の周辺回路を含む)が集積 されたLSIベアチップ200に上に載置され、ボリイ ミド樹脂やエボキシ樹脂等の樹脂からなる応力吸収層 (接着層としての役割も果たす)320を介して固定されている。

【0010】固体摄像索子ベアチップ300の裏面には、バンプ電極301a,301bが設けられている。また、固体摄像索子ベアチップの底面の一部、側壁および上面の一部には、配線層302a,302bが延在し

ており、この配線層302a,302bにより、各バンプ電極301a,301bは、アクティブ面に無積されている固体操像索子と電気的に接続される。なお、図中、参照符号310はフィルタ部材である。

【0011】図2(a),(b)に固体操像素子ベアチップの実装前の構造が示される。(a)は固体操像素子ベアチップの要部の斜視図であり、(b)は要部の断面図である。

【0012】図1において、駆動回路が強積されている LSIベアチップ200は、支持部材(マウント部材) 100上に接着材101により固着されている。

【0013】 LS I ペアチップ200のアクティブ面 (回路が集積される側の面)の中央部は、MOSトラン ジスタ(TR)等が集積されるアクティブ領域(図中、 A2の符号が付されている)となっている。

【0014】また、LSIベアチップの表面には、多層配線技術(層間絶縁膜にスルーホールを設けて、階層の異なる配線同士を接続して多層配線構造を形成する技術)を用いて、電極202a、202b(第1の電極)と、電極201a、201b(第2の電極)とが設けられている。参照符号203は、ファイナルバッシベーション膜(最終保護膜)である。

【0015】電極202a,202b〈第1の電極〉は、固体操像業子ベアチップの裏面のバンプ電極301a,301bとの接続をとるための電極である。電極201a,201b〈第2の電極〉は、キャリアテープ(TABテープ)500a,500bの裏面に形成されたバンプ電極303a,303bとの接続をとるための電極である。キャリアテープ500a,500bの裏面には、バンプ電極303a,303bに連接する配線層(外部導出用の導電部材)501a,501bが設けられている。

【0016】バンプ電極を用いて電気的な接続を確保するときは、例えば、150℃~200℃の加熱および30~50グラムの圧力を加えつつ、0.3μmの超音波振動を与える。この際の負荷は、厚膜のポリイミド樹脂等からなる応力吸収層320により、吸収、緩和されるため、LSIベアチップのアクティブ面は、保護される。

【0017】キャリアテープ500a,500bは、途中で折り曲げられ、折り曲げられた部分が筐体(600a,600b)の内部に挿入され、挿入されたキャリアテープ500a,500bの外側の表面は、筐体600a,600bの内壁に密着している。

【0018】図1の左下側に示されるように、キャリアテープ(TABテープ)500a,500bの裏面に設けられている配線層(外部導出用の導電部材)501a,501bは、支持部材(マウント部材)の側面に設けられた導電層502a,502bを介して、例えば、カメラ制御系700に電気的に接続される。

(4) 002-299595 (P2002-299595A)

【0019】また、キャリアテーアの500a,500 bの、表面側には、接着材503a,503bを介して ガラス等の光透過部材が固着されている。

【0020】図示されるように、光透過部材500a、500b、キャリアテープ管体600a、600bにより、封止体が構成されている。

【0021】図3は、積層された2つのベアチップの配置(上側から見た場合の位置関係)と、アクティブ領域(A2)との関係を示す図である。

【0022】図示されるように、駆動回路を含むベアチップ(LSIベアチップ)がもっとも占有面積が大きく、その中央部がとトランジスタ等が形成されるアクティブ領域AZとなっている。

【0023】そして、アクティブ領域AZを覆うように、固体操像索子ベアチップ300が載置されている。また、固体操像索子ベアチップのバンプ電極(301 a.301b)と、キャリアテーブ裏面のバンプ電極(303a.303b)は、例えば、ベアチップの四隅に位置するように設けられる。

【0024】駆動回路を含むLSIベアチップのアクティブ領域上に固体振像素子ベアチップが存在する構造をとることにより、固体振像素子ベアチップの直下の空間が、無駄にならずに有効に利用される。よって、実装構造の究極的な小型化を図ることができる。

【0025】なお、本実施の形態では、駆動回路ペアチップのアクティブ領域AZを完全に覆うように、固体損像素子ペアチップ300が載度されているが、これに限定されるものではなく、少なくともアクティブ領域の一部と重複するように固体操像素子ペアチップを配置することにより、固体機像素子ペアチップの直下のスペースの有効利用を図ることができる。

【0026】図4に、図1の実装構造を形成するための 基本的な工程(手順)を示す。

【0027】すなわち、まず、裏面に電板が形成された 固体機像素子のベアチップを用意し、また、固体操像素 子のベアチップより占有面積が大きく、かつアクティブ 領域の周辺にベアチップとの電気的接続をとるための第 1の電板と、外部との電気的な接続をとるための第2の 電極とが形成された、固体機像素子の駆動回路を含むし SIベアチップを用意する(工程1000)。

【0028】次に、LSIベアチップのアクティブ領域の少なくとも一部とオーバーラップするように、かつ、固体操像素子の裏面電板とLSIベアチップの第1の電板とが接触するように(接触する形態で)、固体操像素子ベアチップをLSIベアチップに直接に裁匿し、固定する。この場合、樹脂等からなる応力吸収層を介在させるのが望ましい。このとき、固体操像素子の受光面とLSIベアチップの能動面(アクティブ面)は、同じ方向に向いている(工程1001)。

【0029】次に、光透過部財が片側に配置され、反対

側に導電部材が設けられているキャリアテープ(TAB テープ)を用意し、導電部材をLSIベアチップの第2 の電極と接続する(工程1002)。

【0030】そして、キャリアテープ(TABテープ) を途中で直角に折り曲げ、その折り曲げた部分を筐体内 に挿入し、折り曲げた部分の表面を、筐体の内壁に密著 させる(工程1003)。

【0031】このようにして、超小型のカメラ構造が完成する。本実施の形態によれば、バンプ電極を利用したベアチップの階層化と、TAB(テープ・オートメーテッド・ボンディング)を組合せることにより、固体撮像装置の超小型実装構造が実現される。

【0032】(実施の形態2)図5は、本発明の固体操 保装置の断面図である。図1と共通する部分には、同じ 符号を付してある。

【0033】図5の関体操像装置においても、図1の場合と同様に、関体操像素子ベアチップ300を、駆動回路が集積されたLSIベアチップ200上に直接、栽園し、樹脂層(応力吸収層および接着層として機能する)320により固定している。各ペアチップ間の電気的導通は、固体操像素子ベアチップ300の裏面に設けられたバンプ電極301a、301bと、LSIベアチップ200の主面に設けられた電極202a、202bとを接続することにより確保される。

【0034】ただし、図5の固体撮像装置では、LSIベアチップ300の主面の周辺に形成されている電極201a,201bをそれぞれ、ボンディングワイヤ801a,801bを介して、固体撮像モジュールの外部接続端子901a,901bは、モジュールの外に引き出された端子421a,421bに接続される。

【0035】固体操像モジュールの上面には、ガラス等の光透過部材401が設けられ、これにより、ベアチップ200、300は、固体操像モジュールの壁面および光透過部材により気密封止される。

【0036】本実施の形態の実装構造では、信頼性の高いワイヤボンディング技術や、既存のモジュールバッケージの技術をそのまま利用できるというメリットがある。

【0037】図5の実装構造を形成するためのプロセスをまとめると、図6に示すようになる。

【0038】まず、裏面に電極が形成された固体摄像案子のベアチップを用意する。また、固体摄像案子のベアチップを用意する。また、固体摄像案子のベアチップより占有面積が大きく、かつアクティブ領域の周辺に、ベアチップとの電気的接続をとるための第1の電極と、外部との接続をとるための第2の電極とが形成された、固体振像案子の駆動回路を含むLSIベアチップを用意する(工程1100)。

【0039】次に、LSIベアチップのアクティブ領域の少なくとも一部とオーバーラップするように、かつ、

12/13/2005 14:41

HSML, P.C.

間体撮像素子の裏面電極としSIベアチップの電極とが 接触するように、固体撮像素子ベアチップをレSIベア チップに直接に載置し、固定する(工程1101)。応 力吸収層として、ポリイミド樹脂層やエポキシ樹脂層を 介在させるのが望ましい。固体撮像素子の受光面とLS Iベアチップの能動面は、同じ方向に向いている。

【0040】次に、積層化されたベアチップをモジュー ルの底部に固定する(工程1102)、次に、ワイヤー ボンディングを行い、LSIベアチップの第2の電極と モジュールの外部接続用電極とを接続する(工程110 3)。そして、モジュールの上面を、透明部材で封止す る(工程1104)。

【0041】(実施の形態3) 図7は、LSIベアチッ プ200上に固体提像素子ベアチップ300を直接に搭 載したチップオンチップ構造に対して、透明樹脂による コーティングを施し、チップ・サイズ・バッケージを形 成した実装形態を示す。図7において、図1や図5と共 通する部分には同じ符号を付してある。

【0042】図7の実装構造における、2つのベアチッ プ間の電極接続や外部との接続は、図5の実装構造と同 じである。つまり、ベアチップ間の接続にはバンプ電極 を使用し、外部との接続にはワイヤボンディングを用い ている。ペアチップ間には、厚膜の樹脂層320を介在 させて、バンプ電極の接続やワイヤボンディングに伴う 熱や応力から、LSIベアチップのアクティブ面を保護 する.

【0043】なお、LSIベアチップ200は、マウン ト部材100上に固定されている透明樹脂からなるコー ティング940を設けてパッケージ化することで、ベア チップの取り扱いが容易となり、また、耐湿性などが向 上する。

【0044】(実施の形態4)図8(a)は、LSIベ アチップ200と、厨体提像素子ペアチップ300と を、ボンディングワイヤ802a,802bにて接続し た実装構造を示す。前掲の実施の形態と同様に、各ペア チップ間には、樹脂層320が介在している。

【0045】ワイヤボンディングを用いて電気的な接続 を確保するときは、例えば、150℃~200℃の加熱 および30~50グラムの圧力を加えつつ、0.3μm の超音波振動を与える。この際の負荷は、厚膜のポリイ ミド樹脂等からなる応力吸収層320により、吸収、緩 和される。よって、LSIベアチップのアクティブ面は 保護される。

【0046】本実施の形態では、固体提像素子ペアチッ プ300の裏面にバンプ電極を設ける必要がなく、か つ、実績のある信頼性の高いワイヤボンディング技術を 使用できるため、組み立てが容易である。

【0047】図8(6)の実装構造では、固体機像素子 ベアチップ300を、LSIベアチップ200の裏面上 に貼り合わせ、各ペアチップの主面(アクティブ面)に

形成された電極(920a、920bおよび921a、 9216) 間を、ワイヤ803a,803bにより接続 している.

【0048】このような構造では、固体撮像素子ペアチ ップの受光面と、LSIベアチップの能動面 (主面) は、反対の方向に向くことになる。

【0049】各ペアチップの裏面岡士が固着される構造 をとるため、組み立てに伴う負荷が、LSIペアチップ のアクティブ面に加わりにくいというメリットがある。 ただし、ワイヤのショートを防止するために、LSIベ アチップを支持するマウント部材100の形状やサイズ を工失する必要がある。

【0050】図8(a),(b)に示すような実装構造 を形成するための工程をまとめると、図9に示すように なる.

【0051】すなわち、受光面の周辺にポンディングパ ッド接続用の電極が設けられた、関体機像素子のベアチ ップを用意する。また、園体撮像素子のベアチップより 占有面積が大きく、かつ、表面または裏面に、固体提像 素子のペアチップとの電気的接続をとるための電極が形 成された、固体撮像素子の駆動回路を含むLSIベアチ ップを用意する(工程1200)。

【0052】平面的にみて、LSIベアチップのアクテ ィブ領域の少なくとも一部とオーバーラップするよう に、固体摄像素子のベアチップを、LSIベアチップの 主面(あるいは裏面)上に直接に銀冠し、固定する(エ 程1201)、LSIベアチップの主面上に搭載する場 合には、応力吸収層として、ポリイミド樹脂層やエポキ シ樹脂層を介在させるのが望ましい。

【0053】そして、ワイヤーボンディングを行い、固 体撮像素子のペアチップの電極とLSIベアチップの電 極とを接続する(工程1202)。

【0054】以上、本発明をいくつかの実施の形態を用 いて説明したが、これらに限定されるものではない。本 発明は、受光素子(あるいは発光素子)のような光学的 信号を直接に取り扱う素子の構造は、光電変換後の電気 信号を取り扱う転送回路や、駆動回路系の素子の構造と は著しく異なっており、プロセスの共用化が困難であ り、ワンチップ化が困難である点に着目し、それぞれの 機能を個別のベアチップの形態で実現した後、駆動回路 系のチップ上に光処理系のチップを直接に搭載してチッ プ・オン・チップ構造を形成し、光処理領域(光電変換 素子領域)の下に、駆動系回路のアクティブ領域が位置 するという階層構造を実現し、デッドスペース(無駄な スペース)を完全に排除するものである。

【0055】したがって、本発明は、固体撮像索子とそ の駆動系回路に限定されず、例えば、太陽電池のような 受光面を有するベアチップと、その駆動系(あるいは信 号の転送系)の回路を集積したペアチップとの接続にも 使用できるものである.

!(6) 002-299595 (P2002-299595A)

【0056】本発明は、小型カメラや内視鏡のように、超小型化が要求される製品に用いて特に有効である。 【0057】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、駆動回路を含むLSIベアチップ上に固体操像素子のベアチップを搭載してベアチップの階層構造を形成し、ダイレクトに(つまり、プリント配線基板等の基板構造を介することなく)、各ベアチップ間の電気的接続をとる。これにより、実質的な実装サイズ(占有面積)は、下側(支持側)のベアチップのサイズとなり、固体操像装置の実装サイズの究極的な小型化を図ることができる。また、プリント配線基板等の余分な部材がいっさい介在しないため、固体提像装置の実装のローコスト化を実現できる。これにより、実装サイズを究極的に小型化し、また、実装コストの大幅な低減を図ることができる。像装置およびその製造方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の固体撮像装置の実装構造の一例(固体 撮像索子ベアチップをLSIベアチップのアクティブ面 上に直接、搭載した実装構造)を示す断面図

【図2】(a) 裏面にバンプ電極が形成された固体撮像 案子ベアチップの要部の斜視図

(b) 裏面にバンプ電極が形成された固体操像素子ベア チップの要部の断面図

【図3】 固体提像素子ペアチップ, LSIペアチップおよび複数のバンプ電極の、平面的な位置関係を示す図

【図4】図1の固体撮像装置の実装構造を形成するため の工程を示すフロー図

【図5】本発明の固体撮像装置の実装構造の他の例を示す断面図

【図6】図5の固体提像装置の実装構造を形成するため の工程を示すフロー図

【図7】本発明の固体操像装置の実装構造の、さらに他 の例を示す断面図

【図8】(a)本発明の固体操像装置の実装構造の、さらに他の例を示す断面図

(b) 本発明の固体摄像装置の実装構造の、さらに他の 例を示す断面図

【図9】図8(a), (b)に示される固体機像装置の 実装構造を形成するための、主要な工程を示すフロー図 【図10】従来の固体操像装置の実装構造を示す断面図 【符号の説明】

100 マウント都材

101 接着和

200 LSIベアチップ (駆動回路系および転送系回路を含む)

201a, 201b, 202a, 202b 電優

203 最終保護膜

300 固体振像素子ベアチップ

301a, 301b, 303a, 303b バンプ電極

302a, 302b 主面と裏菌とを結ぶ配線

310 フィルタ

400 光透過部材

500 キャリアテープ (TABテープ)

501a,501b 導電層

503a,503b 接着材

600a,600b 筐体

700 カメラ制御系

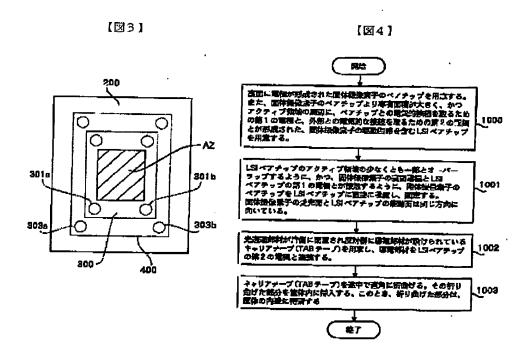
AZ LSIペアチップのアクティブ領域

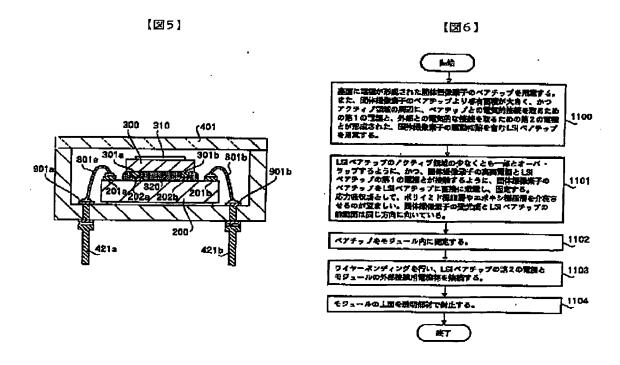
【図1】 【図2】 400 (a) 50ah 800 500b :#01b 600a **300b** 200 100 AZ -**(b)** カメラ制御系 310 800

12/13/2005 14:41

!(7) 002-299595 (P2002-299595A)

HSML, P.C.

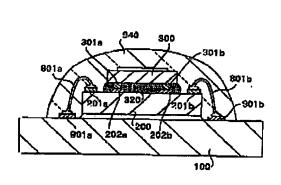


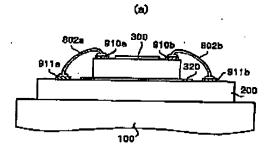


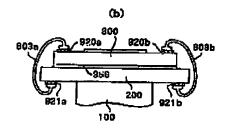
(8) 002-299595 (P2002-299595A)

【図7】

【図8】

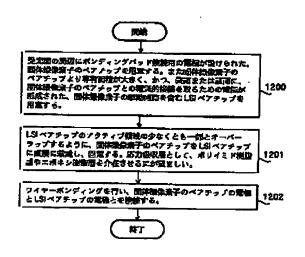


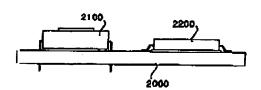




[図9]

【図10】





!(9) 002-299595 (P2002-299595A)

プロントページの続き

(51) Int. C1.7

雌別記号

FΙ

(参考)

PAGE 18/18

HO1L 25/18

31/02

HO4N 5/335

HO1L 31/02

Fターム(参考) 4M118 AA10 AB01 HA02 HA12 HA21

HA22 HA24 HA30 HA31

5C024 CY47 CY48 EX25 HX01

5F044 LL11 RR03 RR18

5F088 BA15 BA18 BB03 EA16 EA20

JA01